PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-001171

(43) Date of publication of application: 07.01.2003

(51)Int.Cl.

B05C 5/02

(21)Application number: 2001-187288

(71)Applicant: HIRANO TECSEED CO LTD

(22)Date of filing:

20.06.2001

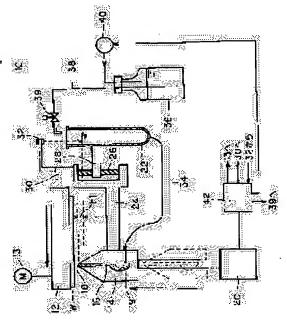
(72)Inventor: MORII NORIO

UEDA KAZUTO

(54) COATING DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a coating device capable of applying a thin coating of a coating liquid to a base material utilizing a capillary action, eliminating a liquid tank for submerging a coating nozzle, and capable of conducting liquid contact and liquid separation quickly. SOLUTION: While moving a base material W with respect to a coating nozzle 14, the coating liquid is supplied to a capillary gap 16 of the coating nozzle 14 from a coating tank 22, and the height of the coating liquid in the coating tank 22 is adjusted. As a result, the coating liquid is brought into liquid contact with the lower face of the base material W from a discharge port 18. After finishing the coating until the predetermined position, the coating tank 22 is lowered and the liquid separation is conducted.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

10.03.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

19.04.2005

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

2005-09565

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision 19.05.2005

of rejection]

[Date of extinction of right]



ACTIONの引例

(19)日本国特齐广 (J.P)

(2) 全開特許会報(A)

(11)特許出版公民委号 特第2003-1171 (P2003-1171A)

(43)公開日 平成15年1月7日(2003.1.7)

(51) Int.CL' B0 6 C 5/02 改別配牙

F1 B0 5 C 5/02

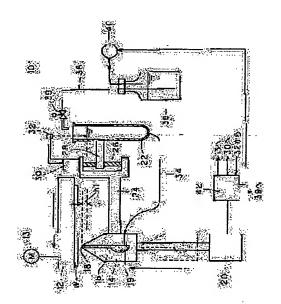
行上下(**多为**) 4 F 0 4 1

		●記憶水、米粉水、砂水平の数9 (OL (金 7 月)
(21)出職番号	45W2001-187288(P2001-187288)	(CD) H. M. A. 600640841
(20) HINH	平成18年6月20日(2001.6:20)	株工会社ヒラノテクシード 奈良味土高城都河合町大井川合101番地の
		(72)発明者、政計・記載
		井樹土。濱田、華子、(外名名)
	·	HERE

(54) 【発明の名称】

(57) (要約) 【課題】 毛細管現象を利用して金工液を基材に薄く金 玉ができるとともに、金エノスルを求めるための液根を なくし、かつ、接液と離液を早く行うことができる途工。 装置を提供する。

【解決手段】、華材Wを連工連工ジスルに対し移動させ。 なから、全工なシク22から全工ノスル14の毛管状隔。 間16日全正液を供給し、全工タンク22の全工液の高 さを調整することによって、吐出口18から全工液を華。 林州の下面に接渡させ、所定位置まで金工が終了する と、全エタンクととを下げて、難波を行うものである。



【特許請求の範囲】

【請求項1】主管状院間を備え、その上端部が全工後の 生出口となった左右方向に延びる全工スズルと

・大夫間放された状態で塗工液を貯留すると共に、前記塗が エンズルに連通されて塗工液を前記塗エンズルに供給可 能な塗工液供給手段と、

坐工対象である基材に前記途エノスルを追奪させた状態で、前記吐出口に沿って当該基材の被途工面を相対的に 前後方向に移動させる移動手取と、

を備え、 的記憶動手段により前記巻材を前記塗工・ノズルとを相対 的に移動させなから、前記塗工液供給手段より前記塗工・ ススルに供給されている塗工液を、前記塗工・ノスルの吐 出口から前記券材の接塗工面へ毛細管現象により塗工することを特徴とずる塗工装置。

【請求項2】前記坐工液供給手段が、

大家開放された状態で逆上液を貯留する逆工タンクと 前記通工タンクを制記値エンスルに対して相対的に上下 動きせる値工タンク上下動手数と。

が記述王ダンク内の液面高さを非接触で検出する液面検 出手度と

を値えることを特徴とする詩求項1記載の金工装置。 (請求項3) 前記波面接出手度によって検出した液面高さる。前記坐工文ンク上で動手成を用いて任意に設定された値に制御する液面制御手段を備えることを特徴上する話求項を記載の塗工装置。

【請求項4】前記法面制御手食は

が記載材が全工開始位置に位置し、かつ、対記途エンスールを対記基材に近接させた状態で、前記液面高さを接液高さ設定値へ相対的に上昇させて放棄の全工液を対記途エンスルに供給して、前記基材の被全工面への接液を促進することを特徴とする話求項3記載の建工装置。

【請求項与】前記液面制御手段は。

が記巻材の接通工面に過工液を塗工している間に対記域で 面高さを建工高さ設定値に推持することを特徴とする請 ま項3記載の過工装置。

【請求項 6】前記液面制御手段は、

対記基材が全工株了位置に位置したとき。前記液面高さ を開液高さ路を値へ相対的に下降されて、前記基材の被 全工面へ接液している全工液を吹引して離液を促進する。 ことを特徴とする請求項の記載の金工装置。

【請求項7】前記绝正タシウより近少した途工済量分を 対策する途工液調充手数を備え、

・対記金工タンクが常時間し金工液量で充満されることを 特徴とする諸求項2からも記載の全工装置。

【請求項8】前記巻付は、長尺状の挙げであり、 前記巻付を前後方向に助送するバックアップロールを前 記金エノズルの上方に配じたことを特徴とする請求項1

から7記載の绝工装置。 【請求項9】前記差材は、仮状の差材であり 前記板状の基体を、下面に吸差して前径方向に推送する。 サクションデーブルを前記途エノスルの上方に配したことを特敵とする請求項1から平記載の途工装置。 【発明の詳細な説明】

[00001]

「発明の属する技術分野」本発明は、基材に途工液を途に 上まる途工装置に関するものである。 (10002)

「世来の技術」県近 液晶表示装置等が広く音及するようになり、この液晶表示装置のガラス板や、そのガラス 一幸切に貼られる保護版に全工液を全工する必要が出てきた。

【0003】このようなガラス基板等の基材に全工液を 望工する方法として、手細管現象を利用した全工装置が 提案されている(特開来8-224528号。特開平6 -3439(8号)。 (00)(041この建工装置は、建工液によって落たされ

【10日04】この建工装置は、建工家によって港たされた接触の内部に毛管状態間を備えたソスルを沈めておき、全工する際にはこのシスルを主導させて基けの下面。近傍に位置させ、毛管状態間から建工液を接液して、基準状の下面に全工液を全工するものである。

[00005]

【完明が解決しようとする課題】上記様式の途工装置であると、 毛細管現象を利用しているため、 基材に途工液、 を薄く塗ることができるという効果がある。

(ロロロ7) また、ノスルを途伸の内部に大めておくため、ノスルを途伸から突出させた状態では、ノスルの周辺に付いた途上流が固まり、この部分の静除が必要になるどともに、ノスルを液伸に大めた壁にこの固まった途上液が不純物となるという問題さもあった。

【QDQ8】。また、毛管状院間から基材に対し望工液を 接液、及び、離液する場合に、毛細管現象を利用している ため、この検液、及び、離液に時間がかかるという問 いるもあった。

(100009)、そこで、本発明は上記問題点に鑑み、毛細管現象を利用じて全工液を基材に達く金工かできるととも」、 グスルを沈めるための液相をなくし、 がっ、接液と難液を早く行うことができる金工装置を提供するものである。 (1000101)

「課題を解決するための手段」請求項「の契明は、主管 状態間を備え、その主集部が塗工液の吐出口となった左右方向に延びる塗工ノズルと、大気開放された状態で塗 工液を貯留すると共に、前記塗工ノズルに連過されて塗 工液を前記・シェスルに供給可能な・金工政供給手段と ・企工対象である基体に前記・金工之スルを近接させた状態で、前記・中出口に沿って当該基体の該・金工面を相対的に 前後方向に移動させる移動手段と、を備え、前記移動手段により前記基体と前記・全工文ズルとを相対的に移動させながら、前記・金工政保給手段より前記・全工ンズルに供 はされている・単工技を、前記・金工ンズルの出出口から前記をはの被・金工政へ、手間を現象により企工することを持 数とする・金工装置である。

【0011】請求項2の発明は、前記塗工液供給手段 が、大気開放された状態で望江液を貯留する望江タンク と、前記金正タンクを前記金エンズルに対して相対的に、 上下動させる金工タンク上下動手段と、前記金工タンク 内の液面高さを非接触で検出する液面検出手段と、を備。 えることを特徴とする諸求項(記載の金工装置である。 [00]2]請求項及の発明は、制記液面検出手段によ って検出した液面高さを、前記途エタンク上不動手食を、 用いて任意に設定された値に制御する液面制御手段を備 えることを特徴とする請求項2記載の途工装置である。 【0043】結束項件の発明は、前記液面制御手段は 対記差材が絶工開始位置に位置し、のわ、前記絶工ノス ルを前記基材に近接させた状態で、前記液面高さを接液 高さ設定値へ相対的に上昇させて微量の金工液を前記金 エンスルに供給して、前記基材の被塗工面への接液を促っ 進することを特徴とする諸求項3記載の途工装置であ ≪చే∻_

【00014】諸求項5の発明は当前記決面制御手段は 前記差材の被絶工面に全工液を绝工している間。前記決 面高さを絶工高さ設定値に推構することを特徴とする諸 求項2記載の絶工装置である。

【00.15】請求項5の発明は、前記液面制御手段は、 前記基材が逆工株了位置に位置したとき、前記液面高さ を離液高さ設定値へ相対的に下降させて、前記基材の接。 逆工面へ接渡している逆工液を吸引して離液を促進する

ことを特徴とする話求項3記載の途工装置である。 【OD16】請求項7の発明は、前記途12クンクより道 少した途工液化分を補充する途工液補充手段を補え、前 >記途エタンクが常時間し途工液化で充満されることを持 数とする話求項2からの記載の途工装置である。

【0.0 】 スト語本項8の発明は、対記基材は、長尺状の。 基材であり、対記基材を封後方向に推送するバックボッ プロールを対記塗エノスルの上方に配したことを持数と する話本項1から2 記載の塗工装置である。

£QQ 18)請求項9の発明は、前記奉材は、振状の奉 材であり。前記版状の基材を、下面に吸着して前後方向 に振送するサクションテーズルを前記坐立ンプルの上方 に配したことを特徴とする請求項)からで記載の坐工装 置である。

[OOT9] 請求項4の金工装置であると、移動手段に より挙述と金工スズルとを相対的に移動されなから、大 気開放された状態で全主弦を貯留している途主弦供給手 度から逆エンスルに逆工液を供給し、途上ンズルの吐出。 口から差好の被逆工面と毛間管現象により逆工する。

100201請求項2の企工装置であると、企工タング 内の液面高さを非接触で液面検出手段で検出じなからこ

・途エタンク上下動手段が途エタンクを途エンスルに対して相対的に上下動させるにとしよって、挙げの接途王面へ毛間管現象により途工する。

10021)請求項3の過工装置は、液面機出手段によって機出した液面高さる。逆工タンタ上下動手段を用いて任意に設定された値に液面制御手段が制御する。

【0022】請求項4において、液面制御手段は、差別が途工開始位置に位置し、かつ、途エススルを基材に近接させた状態で、液面高さを接液高さ設定値へ相対的に 上昇させて減重の途上液を途エススルに供給して、基材の被途工面への接液を促進する。

【DO23】請求項5において、液面制御手及は、基材の販金工面に返工液を塗工している間は、液面高さを塗って高さ設定値に推検する。

【100229】請求項5において、液面制御手段は、基材が望工株子位置に位置したとき、液面高さを離液高さ設定を加い相対的に下降させて、基材の接近工面へ接流している建工液を吸引して離液を促進する。

[00025] 請求項でにおいて、全工液補充手致によっ で坐工タンク内に常に同じ壁の全工液が充満される。 (p0026]

1発明の実施の形態] (第4の実施例) 本発明の第1の。 実施例の企正装置かのについて図が及び図2に基づいて 説明する。

「ロロ27)本実施例の企工装置されば、仮材の季材やに企工液を停工するものである。例えば、液晶表示装置の液晶を以に用いられるカラス版に反射防止層や保護膜を形成するためであり、その企工呼さばの、ロゴルのがら50mである。なお、これは関示であり、液晶を氷のカラス版に限らず、仮状の季材であれば企工可能であり、また、企工液の種類も限定されない。

【0028】(金玉装置の構成)図 Tは、金工装置30の構成図である。

てのことも1 ガラス板等の板状である基材やは、下面に 吸引口を有したサクションデーブルに吸引された状態で 支持されたものであり、このサクションデーブル12 は、モータ13によって前後方向(図1においては、右 ・側から左側)に移動可能となっている。

【QQ3Q】サクションテーブル12の下方には、単析 Wの下面に全工液を全工するための全工ンスル14か配 されている。この全工シスル14は、上部かく方はし状 に尖った形状をなし、左右方向に沿って毛管状間間16 が設けられ。この毛管状隙間15の上端部が全工液の吐 出口18となっている。また、毛管状隙間15の下端部 には、無路された全工液を左右方向に均等に配分する空 間である液温の部ですが設けられている。

(00,31) 単工ノスル14は、その下方に配されたエアジリングまたはデータよりなる上下動装置20によって上下動可能となっている。(図1における主体の状態から実験の状態)。

【0032】 単正メスル14の外部には、単正液を供給するための単正のシク22か裂けられている。すなれる、単二メスル14の単に固定された支持部24には垂直方向にネソ棒26か回転自在に配され、このネン棒26にラック28が設けられている。このラック28に前記した単エタンク22が取り付けられている。ネシ棒26は減速機付きのモータのではよって回動自在であり、モータののを回動させるとネソ棒26は回転し、それを共にラック28、すなわち、単正タンク22が絶エメズル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されているため、建工メスル14に固定されている。

【0033】途王なック22は、途王液が行響されてお。 リ、その上部が開口し、大気に開放された状態となって しる。

【0034】地下タック22の底面がら、地下ノスル14の側面に向かって地下液を供給するための供給がイブ。3.4が設けられている。この供給パイプ3.4から供給された金工液は液温の部1.9に至る。

【00351 支持部24の上部が与非廃棄式(例えば、 光学式)の液面センサ3.2が突出している。この液面セベンサ3.2は、企工タック2.2に治まっている企工液の液 面高さを検出する。

【0036】・単工タック22【・単工液を供給するための 補充タック36か設けられている。この補充タック36 から単工タック22の上部に向かって補充パイプ38か 延びている。補充パイプ88には、不図示のフォルター と電磁弁39が設けられている。当た、補充タック36 は密閉式であり、コンフレッサなどの圧差装置40から 送られてくるイナートカス(例えば、不活性カス、室素 ガス、(N2))(により単工液を補充パイプ38~供給 する。でして、電磁弁39を操作することにより。一定 単の単工液を増工3ツタ22「供給する。ここで、不活 性切べを送るのは妨碍のためてあるが、防機を目的とじ ない場合は、空気などのその他の気体でもよい。

【0037】ごの企工装置10を制御するためにマイク。 ロコンピュータよりなる制御部42が設けられている。 ごの制御部42には、サクジョンデーブル12の移動を (75年-タ13、上下動装置20、企工タング22を上 下動させるモータ30、液面センサ32、電磁弁39。 圧送装置40が接続されている。

【0038】利御部外2社、液面をツサ32によって途・ 工液の液面高さを検出して、その検出したデータに基づい してモータ30を駆動させて途工タック22を上下動き せ、そして、全エタシクミミ内の液面高さを下記で説明 する所定の資定値になるようにフィードバック制御する。

『0039』また。望上によって領土液が少なくなり。 液面センサ32によって検出した液面高さが基準値より 低くなった場合には、制御部4.2は、圧差装置40を作 動させてイナートガスによって圧力をかけ、補充タンタ 36から補充パイプ39を介して領土液を送り、電磁弁 39を操作することにより所定量補充して、常に望工タ ング22内部には、基準値以上の建工液を研留される。 これによって、従来のように廃棄される途工液を暗小限 にすることができる。

【100.40】 (全工方法): 上記構成の全工装置:10を用 いて、挙付Wの下面に全工液を空工する第1の企工方法 につけて図2:(1)、から(4)に基づけて順番に説明し でして。

(1004年) (1) 第5王程(図2(1)多昭) 初期状態では、ガクションテーブル12に基併Wが吸引 され、全正ンズル1/4はその下方に侍機した状態とがっ。 でいる。

【OOS 2】 (2) 第2工程 (図2 (2) 参照) サクションデーブル 1.2 をモータ (13)によって参助さ せ、並はWを迫工開始位置に停止させる。

【ロロ43】また、全工ノズル74を上下動装置20に よって上昇させ、吐出口、18を全工開始位置における幸 、は※の下面の近傍に停止させる。

10044)この場合に、建工フスルル4を共に建工タンク226上昇してくるが、その上昇分だけでなくモータ30を用いて建工タンク22に収納されている建工級の液面高さを、達工ノズル14の毛管状間間16における土場部の位置(すなわち、吐出口)の位置になるように設定する。この設定には、図1に示すように、毛管状限間16の液高さが、61だけ建工タンク22に収納された液高さよりも高くなることを考慮する。この61の高低差がある理由は、毛管状態間16では毛細管現象によって建工ノズル14の上端まで建工液が上昇するからである。以下、この建工タンク22内の液面高さを特機高さ設定値という。

100.453 (3) 第3工程(図2-(3) 参照) 液面センサ32で検知しなから企正タンク22をモータ 30によって企工ノスル14に対して上昇させ、企工タンク22内の液面高さを待機高さ設定値よりも上昇させ、 こ、吐出回1日から途正変が基材災の下面に接渡させる。以下、この企工タンク22内の液面高さを接渡高さ 設定値という。

「000461 これによって、接液を早く確実に行うこと ができる。

【OOA7】なおこより確実に接接をさせるために、生 不動装置 2042ようで、絶エノスル134の高さをやや上 昇させてもよじい (0046) (4) 第4工程(図2(4) 多階)

望工液が差別級の下面に接渡した状態のままで望上タンクと2の高さをモータ30(5よっ 不幸調整して、目的の望工厚さになるように望上タンク222内の液面高さを設定する(以下、2の高さを建工高さ設定値という)。そして、この望工高さ設定値を液面センサ32で検知しながらフィードバック制御により推得もつつ。差別級の下面に選工液を退工しながら、サクションテーマル12をモータ13によって望工間路位置から望工株了位置入移動させる。

で00497。されによって、毎はWの下面に竣工液が適。 正される。

[0.050] (5) 第5工程(図2 (2) 参照) 基材Wの途工教不位置まで途工が終了すると、液面セン サ32で検知しながら途エタンク22の高さをモータ3。 のによって下降させ、途エタンク22内の液面高さを鍵 液高さ設定値まで下げて、吐出口10から途工液を吸引 するようにして、基材Wの下面がら途工液を離液させ るこの離液高さ設定値は、接液高さ設定値と修工高さ 設定値より低い値であり、特機高さ設定値と同し高さで もより、

(CO 5 1) これによって、目的の位置で、全工を終了 することができ、既厚の不安定領域の値を狭くすること かできる。

【0052】 なお、この場合に更に関液を促進するため。 ラッ金エグスル1 4を多したけ下げでもよい。 10058】上記のようにしてに金エクンク22内の液。

面高さを制御することによって、塗り始めと塗り降わり における限度の不安定な領域を狭くし、確実に塗工を行 うごとができる。

[0054] (第20実施期) 第20実施期の独工装置

1012ついで、図さば基づいて説明する。

【0055】本実施別と第1の実施別の異なる点は、全工する基材Wの形状にある。すなわち、第1の実施別では板切の基材Wを用いたが、本実施例では、フェルム等の長尺状の基材Wに全工を行う。

【0.0-5.6】 そのために、途エンスル1.4の上方にはバックアップロール5.0 を配し、この下方に長尺状の基体を割り達すものである。

【100577】3 単正方法については、第1の実施例と同様 である。

[0058]

【発明の効果】以上により本発明であると、途エップル たけて毛細管現象を利用して基材の下面に途工液を途工 することができるので、途工液を無駄に使用することな く、途エアスルが汚れたりすることがなり、更仁、早く がご確実に必要な途工度を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例を示す塗工装置の説明図である。

【図2】(1) から(4) は、並工装置の途工工程を示す図面である。

【図3】第2の実施例の途正装置の説明図である。 【符号の説明】

10 建工装置

12、サクションテーブル

する 海エンズル

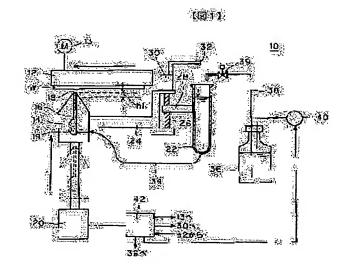
1.6 《毛管状院間》

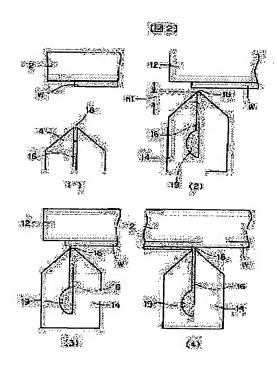
3.8% 单带色

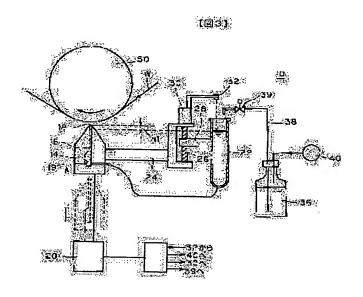
2.2: 全丁なック

32、液面センサ

34 供給パイプ







フロントページの枝き

F文 公(参考) 4F041 MAOT AM12 AM01 BA34. BA52 CA12 CA16